

- [3] FAN S, LIN Y. Multiple-input dual-output adjustment scheme for semiconductor manufacturing process using a dynamic dual-response approach[J]. *ScienceDirect European journal of operational research*, 2007, 39(4):868 – 884.
- [4] INGOLFSSON A, SACHS E. Stability and sensitivity of an EWMA control[J]. *Journal of Quality Technology*, 1993, 25(2): 271 – 287.
- [5] BUTER S W, STEFANI J A. Supervisory run-to-run control of a polysilicon gate Etch using in Situ ellipsometry[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 1994, 7(2): 193 – 201.
- [6] TSENG S T, YEH. A Study of variable EWMA controller[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 2003, 16(4): 633 – 643.
- [7] PATEL N S, MILLER G A, GUINN C, et al. Device dependent control of chemical-mechanical polishing of dielectric films[J]. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 2000, 13(3): 331 – 343.
- [8] FIRTH S K. *Just-in-time adaptive disturbance estimation for run-to-run control in semiconductor process*[D]. USA: the University of Texas, 2002.
- [9] ZHENG Y, LIN Q H, JANG S S, et al. Stability and performance analysis of mixed product run-to-run control[J]. *Journal of Process Control*, 2006, 16(5): 431 – 443.

作者简介:

侯明阳 (1983—), 男, 硕士, 研究方向为半导体生产过程的控制, E-mail: h90001764@huawei.com;

郑英 (1977—), 女, 副教授, 研究方向为半导体生产过程的控制、网络控制、容错控制, E-mail: zyhidu@mail.hust.edu.cn;

艾兵 (1985—), 男, 博士研究生, 研究方向为半导体生产过程的控制, E-mail: aibingbisheng@foxmail.com;

郑燕 (1985—), 女, 硕士研究生, 研究方向为半导体生产过程的控制, E-mail: hndx-zhengyan@163.com;

张杰 (1963—), 男, 副教授, 研究方向为检测与控制, E-mail: zjnet@mail.hust.edu.cn.

第29届中国控制会议征文通知

第29届中国控制会议(CCC'10)将于2010年7月29~31日在北京召开. 大会采用会前讲座、大会报告、专题研讨会、分组报告与张贴论文等形式进行学术交流. 中国控制会议论文集自2005年起由ISTP收录, 2006年起进入IEEE CPP(Conference Publications Program), 2007年起由EI收录. 欢迎广大的海内外控制学者和工程技术人员参加, 就系统与及相关领域的最新理论与应用成果以及未来的发展趋势进行广泛交流.

详细情况请见附件征文通知或访问会议网站: <http://ccc10.bit.edu.cn>.

重要日期:

提交论文初稿日期: 2009年11月1日~12月31日

录用通知日期: 2010年3月15日

提交最终论文截止日期: 2010年4月15日

会议接收中、英文两种语言论文. 论文采用网上投稿, 请登陆<http://ccc.amss.ac.cn/pms>了解具体事宜并投稿. 我们期待您的来稿.